

Planejamento / 2º Sem. 2015 - atualizado em 14/08

Aula Nº	Data	Capítulo / Tema	Professor
1	04/08	Revisão	Diniz
2	06/08	Modelos de transistor MOS	Leandro
3	11/08	2a. Processo nMOS – porta Si-poli 2b. Processo MOS – porta Al. 3b. Tecnologia CMOS em Si	Diniz
4	13/08	1. Evolução da Microeletrônica	Diniz
5	18/08	SILVACO & exercício - separação/equipes	Roberto/ Leandro
6	20/08	3b. Tecnologia CMOS em Si 1. Evolução da Microeletrônica	Diniz
7	25/08	4. Conceitos de cristalografia	Doi
8	27/08	4. Conceitos de cristalografia	Doi
9	01/09	5. Obtenção de cristais de Si e de lâminas	Doi
10	03/09	3a. Escalamento MOS	Leandro
11	08/09	3a. Escalamento MOS	Leandro
12	10/09	SILVACO & exercício no CCS	Roberto/ Leandro
13	15/09	6. Crescimento Epitaxial	Doi
14	17/09	7. Oxidação Térmica de Si	Diniz
15	22/09	7. Oxidação Térmica de Si	Diniz
16	24/09	Prova 1	Doi
17	29/09	8. Difusão de dopantes	Diniz
18	01/10	8. Difusão de dopantes	Diniz
19	06/10	12. Vácuo e Deposição de Filmes Finos por CVD	Doi
20	08/10	12. Vácuo e Deposição de Filmes Finos por CVD	Doi
21	13/10	9. Implantação Iônica	Diniz
22	15/10	9. Implantação Iônica	Diniz
23	20/10	Aula de Silvaco no CCS	Leandro/ Roberto
24	22/10	Prova 2	Roberto
25	27/10	11. Física de Plasma	Stanislav
26	29/10	14. Corrosão por Plasma/Fotolitografia	Stanislav
27	03/11	10. Processos Úmidos e Limpeza	Diniz
28	05/11	10. Processos Úmidos e Limpeza	Diniz
29	10/11	16. Tecnologia “Back-End”	Doi
30	12/11	16. Tecnologia “Back-End”	Doi
31	17/11	Aula de Silvaco no CCS	Leandro/ Roberto
32	19/11	Prova3	Roberto
33	24/11	Finalização-Silvaco no CCS	Roberto/ Leandro/
		Entrega dos exercícios	Diniz/ Leandro Roberto

